

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

«Технология изготовления и метрология тонкоплёночных наноструктур»

Направление подготовки 27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Профиль Метрология наноструктур и нанотехнологий

Квалификация выпускника магистр

Нормативный период обучения 2 года

Форма обучения очная

Год начала подготовки 2018

Цель изучения дисциплины:

Ознакомление студентов с основами технологий получения нитевидных кристаллов; получение студентами знаний об основах метрологического обеспечения процесса получения нитевидных кристаллов.

Задачи изучения дисциплины:

Получение теоретических и практических навыков технологий изготовления нитевидных кристаллов; получение теоретических и практических навыков по разработке, анализу и оценке метрологического обеспечения производства, исследований и контроля качества изготовленной продукции.

Перечень формируемых компетенций:

ПВК-6 - производить оценку качества измерений, контроля и испытаний, обеспечивать эффективность измерений

ПВК-9 - способность ставить и решать прикладные исследовательские задачи, проводит научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с принятыми моделями для проверки их адекватности и при необходимости предлагать новые решения

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой